

分野	国名	発明の名称	出願番号	出願日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
細胞工学	日本	微生物を用いた芳香族ポリエステル分解方法	特願2007-504845	2006/2/24	特許第4753210号	2011/6/3	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4753210/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4753210/15/ja</a>
細胞工学	日本	抗体のリフォールディング方法、リフォールディングされた抗体の製造方法、リフォールディングされた抗体、及びこれらの利用	特願2015-500192	2014/2/3	特許第6453208号	2018/12/21	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6453208/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6453208/15/ja</a>
細胞工学	日本	ポリジメチルシロキサン親和性ペプチド及びその利用	特願2016-574874	2016/2/12	特許第6772074号	2020/10/2	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6772074/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6772074/15/ja</a>
細胞工学	日本	単鎖抗体のスクリーニング方法及び単鎖抗体	特願2017-550314	2016/11/7	特許第6985572号	2021/11/30	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6985572/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6985572/15/ja</a>
細胞工学	日本	転写・翻訳共役型無細胞系タンパク質合成	特願2016-015070	2016/1/29	特許第6921478号	2021/7/30	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6921478/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6921478/15/ja</a>
細胞工学	日本	ピエリシン1AのADPリボシル化ドメイン遺伝子及びセリシン菌	特願2016-136614	2016/7/11	特許第6871547号	2021/4/20	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6871547/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6871547/15/ja</a>
細胞工学	日本	抗体固定ニトロセルロース膜の製造方法及び抗原結合性増強方法	特願2022-018218	2022/2/8	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-018218/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-018218/10/ja</a>
高分子	日本	ゴム組成物及びその製造方法	特願2007-509363	2006/3/27	特許第4867015号	2011/11/25	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4867015/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4867015/15/ja</a>
高分子	日本	リチウムイオン伝導性複合体	特願2005-240113	2005/8/22	特許第4899043号	2012/1/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4899043/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4899043/15/ja</a>
高分子	日本	高分子多相系材料の製造方法および高分子多相系材料	特願2006-013172	2006/1/20	特許第5114703号	2012/10/26	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5114703/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5114703/15/ja</a>
高分子	日本	ポリマーブレンド材料およびその製造方法	特願2006-058522	2006/3/3	特許第5303717号	2013/7/5	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5303717/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5303717/15/ja</a>
高分子	日本	樹脂組成物、樹脂組成物成形体の製造方法、および樹脂組成物の分解方法	特願2022-024660	2022/2/21	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024660/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024660/10/ja</a>
高分子	日本	樹脂組成物、樹脂組成物成形体の製造方法、および樹脂の融点を降下させる方法	特願2022-024666	2022/2/21	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024666/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-024666/10/ja</a>
無機化学	日本	材料の単結晶薄膜製造方法及び単結晶薄膜製造装置	特願2006-179593	2006/6/29	特許第4982845号	2012/5/11	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4982845/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4982845/15/ja</a>
無機化学	日本	発光素子	特願2015-221683	2015/11/11	特許第6732201号	2020/7/10	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6732201/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6732201/15/ja</a>

分野	国名	発明の名称	出願番号	出願日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
無機化学	日本	基体および基体の製造方法	特願2020-078846	2015/11/11	特許第6890858号	2021/5/28	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6890858/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6890858/15/ja</a>
無機化学	日本	薄膜、薄膜付き基板および半導体装置	特願2019-072442	2019/4/5	特許第7290217号	2023/6/5	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290217/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290217/15/ja</a>
無機化学	日本	薄膜の製造方法および半導体装置の製造方法	特願2019-121164	2019/6/28	特許第7290218号	2023/6/5	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290218/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7290218/15/ja</a>
無機化学	日本	基体および基体の製造方法	特願2022-084916	2022/5/25	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-084916/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-084916/10/ja</a>
有機化学	日本	静菌剤、セリシン含有水性組成物及びその製造方法	特願2019-046906	2019/3/14	特許第7320826号	2023/7/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7320826/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7320826/15/ja</a>
有機化学	日本	ダニ防除剤	特願2021-028372	2021/2/25	特許第7659296号	2025/4/1	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-028372/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-028372/10/ja</a>
有機化学	日本	ダニ防除剤	特願2021-204347	2021/12/16	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-204347/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-204347/10/ja</a>
材料	日本	近赤外線発光を示すポルフィリンガラス	特願2018-535648	2017/8/21	特許第6951708号	2021/9/29	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-535648/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-535648/10/ja</a>
材料	日本	ガラス組成物	特願2023-159168	2023/9/22	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-159168/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-159168/10/ja</a>
化学応用	日本	アブラヤシ由来の染色加工材料及びそれを用いた染色加工方法	特願2020-011997	2020/1/28	特許第7411880号	2023/12/28	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7411880/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7411880/15/ja</a>
化学応用	日本	イオン性化学種濃縮方法	特願2022-519948	2021/4/30	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-519948/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-519948/10/ja</a>
化学応用	日本	塗膜形成用組成物、漆塗膜及びその製造方法	特願2022-187170	2022/11/24	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-187170/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-187170/10/ja</a>
化学応用	日本	イオン性化学種濃縮方法および脂質粒子	特願2023-136044	2023/8/24	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136044/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136044/10/ja</a>
化学応用	日本	化合物含有量分析装置、化合物含有量分析方法および化合物含有量分析用セル	特願2023-136891	2023/8/25	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136891/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-136891/10/ja</a>
環境化学	日本	気体分離膜、気体分離膜モジュール、それらの製造方法およびそれらを使用した気体分離方法	特願2022-005301	2022/1/17	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-005301/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-005301/10/ja</a>

分野	国名	発明の名称	出願番号	出願日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
繊維・積層体	日本	ファイブリンナノファイバ複合材料の製造方法、ファイブリンナノファイバ複合ゲルおよびファイブリンナノファイバ含有フィルム	特願2022-070737	2022/4/22	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-070737/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2022-070737/10/ja</a>
繊維・積層体	日本	機能性ファイバ製造方法および機能性ファイバ製造装置	特願2018-086371	2018/4/27	特許第7266270号	2023/4/20	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7266270/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7266270/15/ja</a>
金属材料	日本	高分子自己組織化膜による銅の酸化防止と導電性向上技術	特願2014-172841	2014/8/27	特許第6644461号	2020/1/10	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6644461/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6644461/15/ja</a>
応用物理	日本	荷電粒子発生装置及び加速器	特願2006-550760	2005/12/26	特許第4956746号	2012/3/30	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4956746/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4956746/15/ja</a>
応用物理	日本	金属ナノ粒子を液状化する方法	特願2018-089380	2018/5/7	特許第7197883号	2022/12/20	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7197883/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7197883/15/ja</a>
応用物理	日本	金属ナノ粒子を液状化する方法	特願2022-170293	2022/10/25	特許第7389517号	2023/11/21	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7389517/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7389517/15/ja</a>
応用物理	日本	特定種イオン源およびプラズマ成膜装置	特願2020-525221	2018/11/7	特許第7125789号	2022/8/17	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7125789/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7125789/15/ja</a>
応用物理	日本	触媒、その触媒を含む触媒溶液、およびその触媒溶液を用いた無電解めっき方法	特願2019-204834	2019/11/12	特許第7446598号	2024/3/1	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7446598/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7446598/15/ja</a>
応用光学	日本	フレネルゾーンプレート及び該フレネルゾーンプレートを使用したX線顕微鏡	特願2007-514601	2006/4/18	特許第4568801号	2010/8/20	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4568801/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4568801/15/ja</a>
応用光学	日本	書き換え型ホログラム記録材料、並びに、ホログラムの記録・消去方法およびホログラム記録装置	特願2017-566546	2016/12/28	特許第6855069号	2021/3/19	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6855069/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6855069/15/ja</a>
光制御	日本	フォトニック結晶導波路	特願2006-215608	2006/8/8	特許第4956741号	2012/3/30	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4956741/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4956741/15/ja</a>
光学装置	日本	計測装置	特願2015-512369	2014/3/20	特許第6230598号	2017/10/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6230598/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6230598/15/ja</a>
光学装置	米国	計測装置 MEASUREMENT DEVICE	14/784, 744	2014/3/20	US 10,001,405 B2	2018/6/19	-
光デバイス	日本	紫外発光する有機発光体	特願2018-185347	2018/9/28	特許第7140378号	2022/9/12	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7140378/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7140378/15/ja</a>
光デバイス	日本	紫外発光する有機発光体	特願2019-129584	2019/7/11	特許第7369423号	2023/10/18	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7369423/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7369423/15/ja</a>

分野	国名	発明の名称	出願番号	出願日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
電子デバイス	日本	D型フリップフロップ回路	特願2020-523068	2019/5/30	特許第7299626号	2023/6/20	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7299626/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7299626/15/ja</a>
電子デバイス	日本	ゲート駆動回路および電源回路	特願2020-130812	2020/7/31	特許第7384409号	2023/11/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7384409/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7384409/15/ja</a>
電子デバイス	日本	発電部材およびタッチセンサ装置	特願2021-183160	2021/11/10	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-183160/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-183160/10/ja</a>
電子デバイス	日本	複合基板、半導体装置および複合基板の製造方法	特願2023-129326	2023/8/8	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-129326/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-129326/10/ja</a>
デジタル通信	日本	非同期符号変調信号受信装置	特願2006-149933	2006/5/30	特許第4945747号	2012/3/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4945747/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4945747/15/ja</a>
デジタル通信	日本	非相反メタマテリアル伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2016-031167	2016/2/22	特許第6635546号	2019/12/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635546/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635546/15/ja</a>
デジタル通信	日本	非相反メタマテリアル伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2016-071058	2016/3/31	特許第6635550号	2019/12/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635550/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6635550/15/ja</a>
デジタル通信	日本	非相反伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2018-039017	2018/3/5	特許第6998594号	2021/12/23	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998594/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998594/15/ja</a>
デジタル通信	日本	軌道角運動量モード擬似進行波共振器及び軌道角運動量アンテナ装置	特願2018-039018	2018/3/5	特許第6998595号	2021/12/23	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998595/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6998595/15/ja</a>
デジタル通信	日本	非相反伝送線路装置及びアンテナ装置	特願2020-505019	2019/3/4	特許第7233736号	2023/2/27	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7233736/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7233736/15/ja</a>
デジタル通信	日本	アンテナ装置	特願2018-157467	2018/8/24	特許第7090329号	2022/6/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7090329/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7090329/15/ja</a>
デジタル通信	日本	アンテナ装置	特願2018-158573	2018/8/27	特許第7090330号	2022/6/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7090330/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7090330/15/ja</a>
デジタル通信	日本	擬似進行波共振器及びアンテナ装置	特願2018-158577	2018/8/27	特許第7097064号	2022/6/29	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7097064/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7097064/15/ja</a>
デジタル通信	日本	アンテナ装置	特願2019-029521	2019/2/21	特許第7170319号	2022/11/4	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7170319/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7170319/15/ja</a>
デジタル通信	日本	伝送線路マイクロ波装置	特願2020-165144	2020/9/30	特許第7521796号	2024/7/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2020-165144/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2020-165144/10/ja</a>

分野	国名	発明の名称	出願番号	出願日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
デジタル通信	日本	漏れ波アンテナ装置	特願2023-055441	2023/3/30	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-055441/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-055441/10/ja</a>
デジタル通信	日本	アンテナ装置	特願2023-028499	2023/2/27	-	-	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-028499/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-028499/10/ja</a>
物理測定	日本	超音波粒子径測定器及び超音波測定装置	特願2016-574715	2016/1/28	特許第6685555号	2020/4/3	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6685555/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6685555/15/ja</a>
物理測定	日本	超音波粒子径測定器及び超音波測定装置	特願2020-027251	2020/2/20	特許第6910083号	2021/7/8	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6910083/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6910083/15/ja</a>
物理測定	米国	超音波粒子径測定器及び超音波測定装置	15/549, 734	2016/1/28	US10, 101, 256 B2	2018/10/16	-
物理測定	日本	ゼータ電位測定装置	特願2017-039775	2017/3/2	特許第6867678号	2021/4/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6867678/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6867678/15/ja</a>
電気測定	日本	3次元物体情報計測装置	特願2018-567549	2018/2/9	特許第6995376号	2021/12/17	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6995376/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6995376/15/ja</a>
電気測定	日本	抵抗率測定システム	特願2021-177929	2021/10/29	特許第7689369号	2025/5/29	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-177929/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-177929/10/ja</a>
分析診断	日本	構造物の損傷の診断システムおよび方法	特願2006-321706	2006/11/29	特許第4992084号	2012/5/18	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4992084/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-4992084/15/ja</a>
分析診断	日本	熱量計および熱量計の設計方法	特願2014-529544	2013/8/7	特許第6131406号	2017/4/28	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6131406/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6131406/15/ja</a>
分析診断	日本	押込試験方法および押込試験装置	特願2016-205719	2016/10/20	特許第6779497号	2020/10/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6779497/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-6779497/15/ja</a>
分析診断	日本	表面張力測定方法および表面張力測定装置	特願2019-522054	2018/5/7	特許第7041968号	2022/3/16	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7041968/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7041968/15/ja</a>
分析診断	日本	粘弾性係数測定方法、粘弾性係数測定装置およびプログラム	特願2019-225858	2019/12/13	特許第7353639号	2023/9/22	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7353639/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7353639/15/ja</a>
分析診断	日本	表面張力測定方法、表面張力測定装置およびプログラム	特願2021-005491	2021/1/18	特許第7503843号	2024/6/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7503843/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7503843/15/ja</a>
分析診断	日本	セプトラムおよびヘッドスペースガスクロマトグラフ分析方法	特願2021-059092	2021/3/31	特許第7575067号	2024/10/21	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-059092/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-059092/10/ja</a>

分野	国名	発明の名称	出願番号	出願日	登録番号	登録日	特許情報 (J-PlatPat)
画像応用	日本	画像処理装置、およびそれを備えた超音波撮像装置、並びに画像処理方法	特願2008-508638	2007/3/29	特許第5034054号	2012/7/13	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5034054/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-5034054/15/ja</a>
画像応用	日本	注視対象物同一性判定装置および注視対象物同一性判定プログラム	特願2019-071758	2019/4/4	特許第7287624号	2023/5/29	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7287624/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7287624/15/ja</a>
医療機器	日本	ポリマ被覆線材製造方法およびポリマ被覆線材製造装置	特願2021-002588	2021/1/12	特許第7595341号	2024/11/28	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-002588/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2021-002588/10/ja</a>
ロボティクス	日本	吸着装置、吸着装置を備える無人航空機またはロボット、及び吸着装置の吸着方法	特願2023-151520	2023/9/19	特許第7591109号	2024/11/19	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-151520/10/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2023-151520/10/ja</a>
自動走行システム	日本	飛行制御支援装置および飛行制御支援方法	特願2018-180910	2018/9/26	特許第7141696号	2022/9/14	<a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7141696/15/ja">https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7141696/15/ja</a>